

Фх № 44 від 23.11.2021

## Відгук

на проєкт освітньої програми  
«Технології друкованих і електронних видань»  
зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»  
навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту  
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Україна розвивається в економічному, технологічному, суспільному напрямках, що веде за собою необхідність жорсткішого врахування вимог стандартів та підвищення загального рівня підготовки здобувачів. Сучасна професійна освіта вимагає від ЗВО дотримання найжорсткіших вимог щодо оновлення дисциплін відповідно до ринкових змін, можливість їх адаптації до новітніх технологій та закріплення знань, необхідних майбутнім випускникам для успішного працевлаштування.

Запропонована освітньо-професійна програма є актуальною та сучасною, що підтверджується широким охоптом компонентів освітньої програми, та наявністю дисциплін за прогресивними напрямками. Заслуговують на увагу такі глобальні дисципліни, як «Технології електронних видань», «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва», «Технології видавництва та поліграфії» із значною кількістю кредитів, які в повному обсязі дозволяють подати увесь необхідний матеріал студентам. Загалом за розподілом кредитів дисциплін спостерігається баланс. Однак, цикл загальної підготовки має компоненти які за потреби можуть бути дещо зменшені на користь збільшення циклу професійної підготовки. Примітно, що цикл професійної підготовки підкріплений двома видами практик.

Загалом можна стверджувати, що реалізація даної програми дозволить суттєво підвищити рівень підготовки бакалаврів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», та забезпечити дотримання сучасних вимог щодо навчання фахівців видавничо-поліграфічної справи.

Доктор технічних наук, професор  
кафедри інформаційних технологій  
видавничої справи, Інституту  
комп'ютерних наук та інформаційних  
технологій Національного університету  
«Львівська політехніка»

Марія НАЗАРКЕВИЧ

Підпис д.т.н., проф. Марії Назаркевич засвідчую  
Вчений секретар НУ «Львівська політехніка»

Брилинський Р. Б.

